

# 垂直爐管儀器簡介

機台編號	儀器名稱 / Class 100	開放等級	放置位置
CF-T13	垂直爐管 Vertical Furnace	B3	奈米 Class 100

一、垂直爐管之規格及型號：

1. ASM Vertical Furnace system , for 8" wafer 。
2. 單 Run 最多片數 100 片 。

二、標準製程：

製程項目		溫度(°C)	規格
Tube01	Dry-Oxidation	800 900	20~100Å 100~500Å
	Wet-Oxidation	900 1000	200~1,000Å 1000~5,000Å
Tube02	N <sup>+</sup> Poly-Si	550	100~5,500Å
	Poly-Si	623	100~5,000Å
	α-Si	550	100~1,000Å

三、特殊注意事項：

1. 委託之晶片依序填妥晶片之型式、材料、雜質種類濃度、方向、厚度、直徑、形狀及數量。
2. 除新開封晶圓外，請務必註明該晶圓先前做過 TSRI 何種製程？（如：是否有含光阻....）。
3. 拒收含缺角、光阻、金屬、不明物、III-V 族的晶圓、經非 NDL 前段設備處理的晶圓。
4. 厚度以不超過 10,000Å 為原則。
5. 若違反上述規定，造成機台污染或損害，除停止其使用權外，並追究相關賠償責任。